

강 의 계 획 서

소속	전자정보대학	학과	전자공학부
성명	박근형	연락처	
교과목명	반도체공정	강의학기	2014년도 2 학기
교과목 설명	반도체 IC 소자 제조 공정 기술을 가르친다. 웨이퍼 제조공정, CVD 박막 증착기술, 산화공정, 확산 공정, 리소그라피 기술, 식각 기술, 금속막 증착기술, 세정 기술, CMOS 일괄제작기술 등을 강의한다.		
강의 공개 동의 확인	<input checked="" type="checkbox"/> KOCW(Korea Open CourseWare) 강의 공개		
주차별 강의 내용			
1주차	웨이퍼 성장 및 가공		
2주차	Chemical Vapor Deposition		
3주차	Epitaxial Growing Technology		
4주차	Oxidation		
5주차	Diffusion		
6주차	Ion Implantation		
7주차	Al and Cu Metallization		
8주차	Silicide/ Refractory Metal Deposition		
9주차	Optical Lithography		
10주차	Advanced Lithography		
11주차	Dry Etching		
12주차	Wet Etching and Cleaning		
13주차	CMOS Process Integration		

본인은 위와 같이 KOCW 강의자료 공개용 강의계획서를 제출합니다.

2014년 7 월 30 일
성명 박근형 (인)



※참조1